Сканирующий электронный микроскоп SEM4000X(G2)



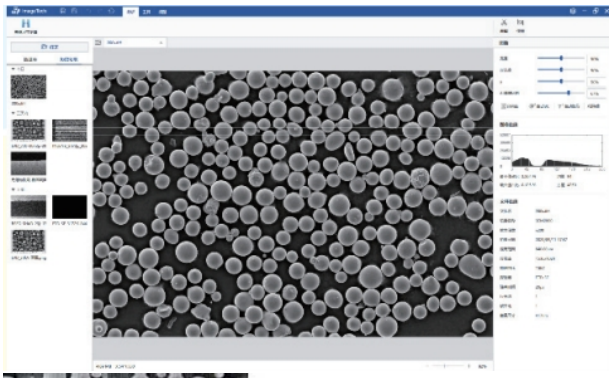
Сканирующий электронный микроскоп с полевой эмиссией для микроанализа и контроля для современных лабораторий материаловедения, обеспечивающий получение изображений высокого разрешения при низком напряжении. SEM4000X(G2) - удобный в использовании сканирующий электронный микроскоп с многодетекторной системой и возможностью замедления пучка. SEM4000X(G2) представляет собой надежное решение сочетающее в себе высокую производительность, надежность и низкую стоимость владения. Программное обеспечение позволяет проводить количественный анализ статистики частиц и пор и может применяться в таких областях, как материаловедение, геология и экология.

Технические характеристики сканирующий электронный микроскоп SEM4000X(G2):

Электронная оптика	Разрешение	0,9 нм при 30 кВ, SE; 1,0 нм при 15 кВ, SE; 1,8 нм при 1 кВ, SE 1,5 нм при 1 кВ (ультразамедление пучка) 0,8 нм при 15 кВ (ультразамедление пучка)
	Напряжение ускорения	0,2 кВ ~ 30 кВ
	Увеличение (Polaroid)	1 ~ 1 000 000 x
	Электронная пушка	Электронная пушка Шоттки с полевой эмиссией
Камера для образцов	Камера	Двойная камера (оптическая навигация + мониторинг камеры)
	Диапазон стадий	X: 110 мм; Y: 110 мм; Z: 65 мм T: -10°~ +70° R: 360°
Детекторы и расширения для сканирующего электронного микроскопа	Стандарт	Внутрилинзовый электронный детектор: UD-BSE/UD-SE Детектор Эверхарта-Торнли: ЛД
	Опции	Детектор обратнорассеянных электронов (BSED); Выдвижной детектор сканирующей просвечивающей электронной микроскопии (STEM); Детектор низкого вакуума (ДНВ); Энергодисперсионный спектрометр (EDS/EDX); Дифракционная картина обратного рассеяния электронов (EBSD); Шлюз для обмена образцами (4 дюйма / 8 дюймов); Панель управления с трекболом и поворотными регуляторами; Технология сверхбыстрого замедления луча.
Пользовательский интерфейс	Язык	Английский
	ОС	Windows
	Навигация	Оптическая навигация, быстрая навигация жестами, трекбол (опционально)
	Автоматические функции	Автоматическая регулировка яркости и контрастности, автофокусировка, автоматический стигматизатор.

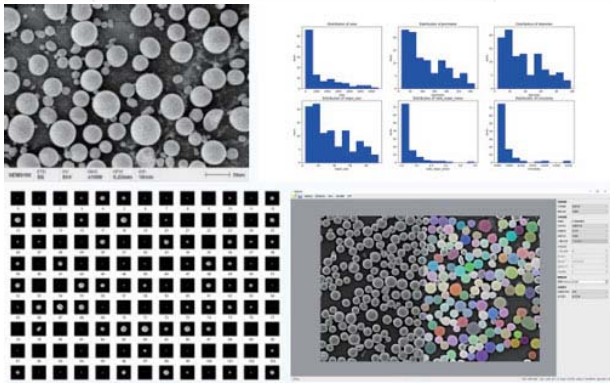
- Высокое разрешение; Многодетекторная технология; Упрощенное выравнивание;
- Отличные возможности расширения; Создано на основе высокопроизводительной платформы;
- Технология режима сверхбыстрого замедления (опционально);

Программное обеспечение SEM



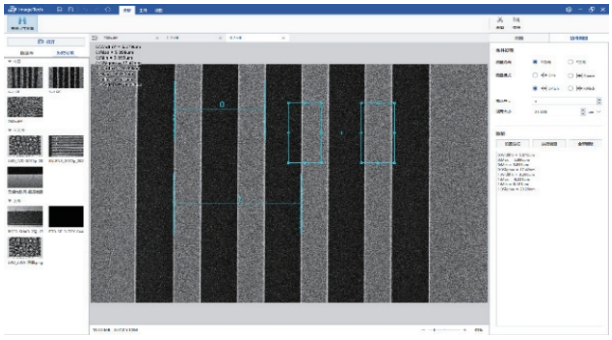
Программное обеспечение для постобработки изображений

Позволяет выполнять онлайн или офлайн постобработку изображений, полученных с помощью электронных микроскопов, и интегрирует часто используемые функции обработки изображений ЭМ, удобные инструменты измерений и аннотаций.



Программное обеспечение для анализа частиц и пор (опция)

Программное обеспечение микроскопа CIQTEK SEM использует различные алгоритмы обнаружения и сегментации целей, подходящие для разных типов образцов частиц и пор. Оно позволяет проводить количественный анализ статистики частиц и пор и может применяться в таких областях, как материаловедение, геология и экология.



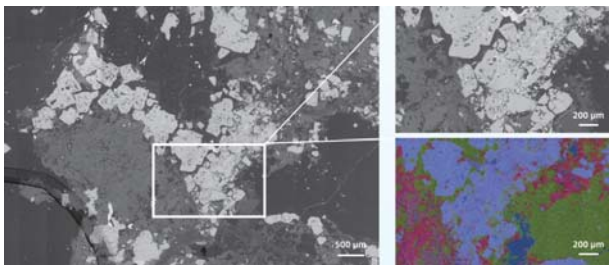
Автоматическое измерение (Опция)

Автоматическое распознавание границ линий, что обеспечивает более точные измерения и более высокую стабильность. Поддержка различных режимов определения границ, таких как «Линия», «Пробел», «Шаг» и т. д. Совместимость с различными форматами изображений и широкий набор распространённых функций постобработки изображений. Программа проста в использовании, эффективна и точна.



Комплект для разработки программного обеспечения (SDK) (опция)

Предоставляет набор интерфейсов для управления микроскопом SEM, включая получение изображений, настройку рабочих условий, включение/выключение питания, управление предметным столиком и т. д. Чёткие определения интерфейсов позволяют быстро разрабатывать специальные сценарии и программное обеспечение для работы электронного микроскопа, обеспечивая автоматическое отслеживание интересующих областей, сбор данных для промышленной автоматизации, коррекцию дрейфа изображения и другие функции. Может использоваться для разработки программного обеспечения в специализированных областях, таких как анализ диатомовых водорослей, контроль примесей в стали, анализ чистоты, контроль сырья и т. д.



Автоматическое картографирование (опция)